

# 貸付機械器具一覧

【R6.11.1現在※】

機器番号	機 器 名	料金 (円/時間)
M100	旋盤	620
M102	帯のこ盤	290
M103	小型平面研削盤	900
M106	精密切断機	580
M108	ジグ中ぐりフライス盤	690
M109	NC放電加工機 (E A 1 2 E)	1,490
M111	雰囲気調整電気炉	1,950
M112	高周波誘導電気炉	1,520
M113	放電プラズマ焼結機	2,320
M114	高周波誘導式真空溶解炉	2,770
M115	粉末処理装置	150
M116	手動切断機	260
M117	試料埋込機	1,400
M118	自動研磨装置	3,830
M119	精密ワイヤ放電加工機	2,690
M121	高速加工機	3,220
M122	CAD/CAMシステム	700
M123	超高温電気炉	330
M124	真空含浸装置	690
M125	精密切断機(硬質・脆性材料切断)	1,120
M200	万能試験機	650
M201	精密万能試験機(250kN)	1,270
M203	表面性測定機	680
M204	内部欠陥判定装置	470
M205	ワックス物性試験機	180
M206	塩乾湿複合サイクル試験機装置	1,740
M207	シャルピー衝撃試験機	240
M208	高温顕微硬度計	2,440
M209	薄膜硬度計	560
M210	摩擦磨耗試験機	1,420
M211	高解像度ハイスピードカメラ	1,410
M212	表面粗さ測定装置	1,780
M214	CNC三次元測定機	4,450
M215	万能形状測定装置	1,040
M216	サーモグラフィ	910
M219	構造解析システム	1,710
M220	3次元湯流れ凝固解析システム	430
M222	測定顕微鏡	840
M223	万能投影機	370
M224	超微小硬さ試験機	550
M225	デジタル金属顕微鏡	610
M226	コンピュータ設計支援システム	500
M227	加工機制御用CAD/CAMシステム	790
M228	高性能マイクロフォーカスX線CTシステム(計測処理)	8,250
M230	表面性状測定機	2,600
M231	高倍率型マイクロ스코プ	600
M232	卓上型走査電子顕微鏡	2,320
M233	微細形状観察評価装置(レーザー顕微鏡)	1,990
M234	高性能マイクロフォーカスX線CTシステム(ポスト処理)	950
M235	非接触3次元デジタル計測システム	2,020
M236	精密騒音計	350
M237	風量測定器	770
M238	設計・シミュレーションシステム	3,820

P100	サンプルカット用プロッタ	430
P101	3Dプリンタ①(材料持込)	890
P102	3Dプリンタ②(0.1mm)	1,160
P103	3Dプリンタ③(0.2mm)	1,460

機器番号	機 器 名	料金 (円/時間)
C102	精密切断機	920
C104	マイクロカuttingマシン	540
C105	小型射出成形機	1,100
C106	油圧真空加熱プレス	1,410
C107	自転公転式攪拌脱泡装置	250
C108	ノッチ加工機	950
C200	FT赤外分光光度計	2,690
C201	X線回折装置	3,410
C203	静荷重試験機	1,590
C205	FE-SEM/EDS	10,130
C206	FE-SEM/EDS/WDS	13,530
C207	FE-SEM	7,370
C208	熱分析装置	2,080
C209	微小部蛍光X線分析装置(X線分析顕微鏡)	2,800
C211	粉体特性評価装置	810
C212	熱分解ガスクロマトグラフ質量分析装置	4,990
C213	レーザー回折式粒度分布測定器	1,940
C214	混練性・押出性試験装置	3,930
C216	比表面積・細孔分布測定装置	790
C217	X線光電子分光分析装置	4,510
C218	イオンクロマトグラフ(陽イオン)	1,710
C219	イオンクロマトグラフ(陰イオン)	1,680
C220	イオンミリング	5,150
C221	高周波プラズマ発光分析装置	3,590
C222	低温プラズマ分解装置	530
C223	マイクロサンプリングマシン	970
C225	マイクロ波分解装置	880
C227	紫外可視分光光度計	180
C229	恒温恒湿器(新)	170
C230	卓上型pHメーター	420
C231	実体顕微鏡システム	180
C232	精密断面試料作製装置	4,280
C233	オスミウムコータ	1,190
C234	カーボンコータ	2,110
C235	白金コータ	630
C236	精密平面研磨機	2,620
C237	自動精密切断機	1,510
C238	精密位置合わせ顕微鏡	200
C239	自動研磨装置	4,000
C240	スパイラルTOF	9,890

W100	丸鋸昇降盤	200
W101	軸傾斜横挽丸鋸盤	190
W102	手押し鉋盤	220
W103	自動鉋盤	380
W104	定温乾燥機	310
W105	ディスクリファイナー	1,320
W106	ホットプレス	470
W107	恒温恒湿器	180

J100	電磁界解析ツール	720
J104	微小部X線応力測定装置	1,020
J105	三次元磁界ベクトル分布測定装置	170
J106	真空均温熱処理装置	750

機器番号	機 器 名	料金 (円/時間)
J200	磁気シールドルーム	11,630
J201	ヘルムホルツコイル	330
J202	直流磁化測定装置	1,970
J203	ソレノイドコイル	520
J204	校正用機器	160
J205	ガウスメータ	250
J206	レーザドップラ振動計	1,630
J207	パワーアンプ	540
J208	パワーアナライザ	770

F101	低温恒温恒湿機	360
F102	クリーンベンチ	210
F103	真空凍結乾燥機	1,290
F105	真空包装機	190
F106	低温高速遠心機	350
F107	プレハブ仕込室	190
F108	高温高圧調理殺菌装置	1,740
F111	細胞破砕装置	220
F112	微生物増殖装置	510
F117	スプレードライヤー	290
F118	高圧ホモジナイザー	370
F119	微細装置	610
F121	ホモジナイザー	160
F122	ロータリーエバポレーター	150
F200	水分活性測定装置	480
F201	測色色差計	390
F207	高速液体クロマトグラフ	1,320
F208	キャピラリーガスクロマトグラフ	750
F212	原子吸光分析装置	930
F213	pHメーター	210
F214	密度比重計	150
F215	蛍光プレートリーダー	820
F216	高速液体クロマトグラフ質量分析計	5,930
F218	3次元観察マイクロSCOPE	1,340
F219	微生物簡易同定システム	7,910

E100	スパッタリング装置	1,910
E104	真空熱処理装置	970
E200	高精度12bit型ミックスド・シグナル・オシロスコープ	270
E204	分光光度計(電子材料分光特性評価装置)	580
E209	ネットワーク・アナライザ	590
E300	電波暗室	5,310
E301	雑音電界強度測定器	1,810
E302	雑音端子電圧測定器	1,720
E303	雑音電力測定器	1,670
E304	ハンドヘルドスペクトラムアナライザ	240
E305	放射イミュニティ試験器	2,230
E306	伝導イミュニティ試験器	1,310
E307	静電気試験器	300
E308	商用磁界試験器	450
E309	アンテナ計測システム	1,220
E310	オシロスコープ	310
E311	ノイズ可視化装置	560
E400	ドローンテスト用ネット	1,220

999	その他の機械器具	100
-----	----------	-----